

2026年度 塩野浄水場 薬品注入設備外更新工事  
薬注設備工事  
附带電気設備  
数 量 計 算 書

附帯電気設備  
更新据付 数量計算書







[薬品注入設備（更新）]

[illegible]

(1)薬品注入設備盤（更新）（ 1/ 1）

据 付 工 集 計 表

〔薬品注入設備（更新）〕

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	機器重量(t)		備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		単位重量	重量	
薬品注入設備制御盤 W2800×D800×H2150	屋内自立	面	1		1.9		4.6								動力盤 3 W1200xD800xH2150
(薬品注入設備制御盤)	屋内自立	面	1		2.3		5.3								動力盤4 W1600×D800×H2150
沈澱水残塩計		台	1		0.41		1.3								発信機類
計 (S-101)				4.61		11.2									

(1)薬品注入設備盤（更新）（ 1/ 1）

## 試 験 工 集 計 表

[薬品注入設備（更新）]

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		
負荷試験	負荷試験	負荷	15	0.81	12.15								注入機×7、引出弁×6 攪拌機×2
ループ試験(制御なし)	ループ試験	ループ°	12	0.32	3.84								貯蔵槽液位 貯蔵槽電極
沈澱水残塩計	ループ試験	ループ°	1		0.32								
計 (T-101)				16.31									

[薬品注入設備（更新）]

電工量小計= 19.049

[薬品注入設備（更新）]

電工量小計= 8.737

[薬品注入設備（更新）]

電工量小計= 3.267

[薬品注入設備（更新）]

電工量小計= 20.474





[薬品注入設備（更新）]

( 1/3)	CHK ( 1- 1)	41.3	58.9	38.8	11.8	17.9	6.6	35.4	55.6	30.7	35.4	56.4	36.1	41.3	58.9	38.8
--------	-------------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(1)薬品注入設備盤（更新）

材 料 内 訳 表

[薬品注入設備（更新）]

[illegible]

(1)薬品注入設備盤（更新）

材 料 内 訳 表

〔薬品注入設備（更新）〕

NO	配線区間 自 至		IE/F				HIVE				HIVE											
			2 sq				36 mm				22 mm											
			P&D	RACK	CP	FEP	露出	埋込			露出	埋込										
101	薬品注入設備	M-1			17.1						3.3											
102	薬品注入設備	M-2			19.2						3.3											
103	薬品注入設備	K-1			19.3						4.1											
104	薬品注入設備	K-1					4.1															
105	薬品注入設備	K-1									3.8											
106	薬品注入設備	K-2			18.0						4.1											
107	薬品注入設備	K-2					4.1															
108	薬品注入設備	K-2									3.8											
109	薬品注入設備	K-3			16.4						4.2											
110	薬品注入設備	K-3					4.2															
111	薬品注入設備	K-3									3.9											
112	薬品注入設備	K-4			14.9						4.2											
113	薬品注入設備	K-4					4.2															
114	薬品注入設備	K-4									3.9											
115	薬品注入設備	K-5			22.8						7.6											
116	薬品注入設備	K-5					7.6															
117	薬品注入設備	K-5									7.3											
118	薬品注入設備	K-6			23.6						7.1											
119	薬品注入設備	K-6					7.1															
120	薬品注入設備	K-6									6.8											
121	薬品注入設備	K-7			24.0						7.5											
122	薬品注入設備	K-7					7.5															
123	薬品注入設備	K-7									7.2											
124	薬品注入設備	MV-1									6.3											
125	薬品注入設備	MV-2									6.6											
126	薬品注入設備	MV-3									3.6											
127	薬品注入設備	MV-4									3.6											
128	薬品注入設備	MV-5									7.8											
129	薬品注入設備	MV-6									8.2											
130	薬品注入設備	LF-1									5.1											
131	薬品注入設備	LF-2									5.3											
132	薬品注入設備	LF-3									2.4											
133	薬品注入設備	LF-4									2.4											
134	薬品注入設備	LF-5									7.4											
135	薬品注入設備	LF-6									7.8											
136	薬品注入設備	LX-1			22.4						5.9											
137	薬品注入設備	LX-1									5.6											
138	LX-1	LT-1									3.3											
139	薬品注入設備	LX-2			20.1						6.2											
140	薬品注入設備	LX-2									5.9											
( 3/3) 続<																						

[薬品注入設備（更新）]

7-1-4



(1)薬品注入設備盤（更新）（ 1/ 11）

拾い出し根拠表

[薬品注入設備（更新）]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
101	薬品注入設備 制御盤	M-1 1号 苛性ソーダ攪拌機	600V CE/F 2 sq - 3 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	7.9	3.7 + 3.8 + 0.4
				CP	3.3	1.9 + 1.2 + (0.2)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	17.1	5.9 + 7.9 + 3.3
			HIVE 22 mm	露出	3.3	1.9 + 1.2 + (0.2)
				埋込		
102	薬品注入設備 制御盤	M-2 2号 苛性ソーダ攪拌機	600V CE/F 2 sq - 3 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	10.0	3.7 + 3.8 + 0.4 + 1.7 + 0.4
				CP	3.3	1.9 + 1.2 + (0.2)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	19.2	5.9 + 10.0 + 3.3
			HIVE 22 mm	露出	3.3	1.9 + 1.2 + (0.2)
				埋込		
103	薬品注入設備 制御盤	K-1 1号 PAC注入機	600V CE/F 3.5 sq - 2 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	9.3	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3
				CP	4.1	1.2 + (2.9)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	19.3	5.9 + 9.3 + 4.1
			HIVE 22 mm	露出	4.1	1.2 + (2.9)
				埋込		
104	薬品注入設備 制御盤	K-1 1号 PAC注入機	CEE/F 1.25 sq - 15 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	9.3	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3
				CP	4.1	1.2 + (2.9)
				FEP		
				CP		
			HIVE 36 mm	露出	4.1	1.2 + (2.9)
				埋込		
105	薬品注入設備 制御盤	K-1 1号 PAC注入機	CEE/F-S 1.25 sq - 4 c	P&D	5.6	(1.5)+ 1.5 + (2.6)
				RACK	9.3	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3
				CP	3.8	1.2 + (2.6)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	3.8	1.2 + (2.6)
				埋込		

(1)薬品注入設備盤（更新）（ 2/ 11）

拾い出し根拠表

[薬品注入設備（更新）]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
106	薬品注入設備 制御盤	K-2 2号 PAC注入 機	600V CE/F 3.5 sq - 2 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	8.0	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7
				CP	4.1	1.2 + (2.9)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	18.0	5.9 + 8.0 + 4.1
			HIVE 22 mm	露出	4.1	1.2 + (2.9)
				埋込		
107	薬品注入設備 制御盤	K-2 2号 PAC注入 機	CEE/F 1.25 sq - 15 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	8.0	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7
				CP	4.1	1.2 + (2.9)
				FEP		
				CP		
			HIVE 36 mm	露出	4.1	1.2 + (2.9)
				埋込		
108	薬品注入設備 制御盤	K-2 2号 PAC注入 機	CEE/F-S 1.25 sq - 4 c	P&D	5.6	(1.5)+ 1.5 + (2.6)
				RACK	8.0	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7
				CP	3.8	1.2 + (2.6)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	3.8	1.2 + (2.6)
				埋込		
109	薬品注入設備 制御盤	K-3 1号 苛性ソ ーダ注入機	600V CE/F 3.5 sq - 2 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	6.3	3.7 + 1.1 + 1.5
				CP	4.2	1.3 + (2.9)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	16.4	5.9 + 6.3 + 4.2
			HIVE 22 mm	露出	4.2	1.3 + (2.9)
				埋込		
110	薬品注入設備 制御盤	K-3 1号 苛性ソ ーダ注入機	CEE/F 1.25 sq - 15 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	6.3	3.7 + 1.1 + 1.5
				CP	4.2	1.3 + (2.9)
				FEP		
				CP		
			HIVE 36 mm	露出	4.2	1.3 + (2.9)
				埋込		

(1)薬品注入設備盤（更新）（ 3/ 11）

拾い出し根拠表

〔薬品注入設備（更新）〕

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
111	薬品注入設備 制御盤	K-3 1号 苛性ソーダ注入機	CEE/F-S 1.25 sq - 4 c	P&D	5.6	(1.5)+ 1.5 + (2.6)
				RACK	6.3	3.7 + 1.1 + 1.5
				CP	3.9	1.3 + (2.6)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	3.9	1.3 + (2.6)
				埋込		
112	薬品注入設備 制御盤	K-4 2号 苛性ソーダ注入機	600V CE/F 3.5 sq - 2 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	4.8	3.7 + 1.1
				CP	4.2	1.3 + (2.9)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	14.9	5.9 + 4.8 + 4.2
			HIVE 22 mm	露出	4.2	1.3 + (2.9)
				埋込		
113	薬品注入設備 制御盤	K-4 2号 苛性ソーダ注入機	CEE/F 1.25 sq - 15 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	4.8	3.7 + 1.1
				CP	4.2	1.3 + (2.9)
				FEP		
				CP		
			HIVE 36 mm	露出	4.2	1.3 + (2.9)
				埋込		
114	薬品注入設備 制御盤	K-4 2号 苛性ソーダ注入機	CEE/F-S 1.25 sq - 4 c	P&D	5.6	(1.5)+ 1.5 + (2.6)
				RACK	4.8	3.7 + 1.1
				CP	3.9	1.3 + (2.6)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	3.9	1.3 + (2.6)
				埋込		
115	薬品注入設備 制御盤	K-5 前次亜注入機	600V CE/F 3.5 sq - 2 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	9.3	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3
				CP	7.6	3.8 + 0.9 + (2.9)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	22.8	5.9 + 9.3 + 7.6
			HIVE 22 mm	露出	7.6	3.8 + 0.9 + (2.9)
				埋込		



(1)薬品注入設備盤（更新）（ 4/ 11）

拾い出し根拠表

[薬品注入設備（更新）]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
116	薬品注入設備 制御盤	K-5 前次亜注入機	CEE/F 1.25 sq - 15 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	9.3	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3
				CP	7.6	3.8 + 0.9 + (2.9)
				FEP		
				CP		
			HIVE 36 mm	露出	7.6	3.8 + 0.9 + (2.9)
				埋込		
117	薬品注入設備 制御盤	K-5 前次亜注入機	CEE/F-S 1.25 sq - 4 c	P&D	5.6	(1.5)+ 1.5 + (2.6)
				RACK	9.3	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3
				CP	7.3	3.8 + 0.9 + (2.6)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	7.3	3.8 + 0.9 + (2.6)
				埋込		
118	薬品注入設備 制御盤	K-6 中次亜注入機	600V CE/F 3.5 sq - 2 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	10.6	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3 + 1.3
				CP	7.1	3.8 + 0.4 + (2.9)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	23.6	5.9 + 10.6 + 7.1
			HIVE 22 mm	露出	7.1	3.8 + 0.4 + (2.9)
				埋込		
119	薬品注入設備 制御盤	K-6 中次次亜注入機	CEE/F 1.25 sq - 15 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	10.6	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3 + 1.3
				CP	7.1	3.8 + 0.4 + (2.9)
				FEP		
				CP		
			HIVE 36 mm	露出	7.1	3.8 + 0.4 + (2.9)
				埋込		
120	薬品注入設備 制御盤	K-6 中次次亜注入機	CEE/F-S 1.25 sq - 4 c	P&D	5.6	(1.5)+ 1.5 + (2.6)
				RACK	10.6	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3 + 1.3
				CP	6.8	3.8 + 0.4 + (2.6)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	6.8	3.8 + 0.4 + (2.6)
				埋込		

(1)薬品注入設備盤（更新）（ 5/ 11）

拾い出し根拠表

[薬品注入設備（更新）]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
121	薬品注入設備 制御盤	K-7 後次亜注入機	600V CE/F 3.5 sq - 2 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	10.6	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3 + 1.3
				CP	7.5	3.8 + 0.8 + (2.9)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	24.0	5.9 + 10.6 + 7.5
			HIVE 22 mm	露出	7.5	3.8 + 0.8 + (2.9)
				埋込		
122	薬品注入設備 制御盤	K-7 後次亜注入機	CEE/F 1.25 sq - 15 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	10.6	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3 + 1.3
				CP	7.5	3.8 + 0.8 + (2.9)
				FEP		
				CP		
			HIVE 36 mm	露出	7.5	3.8 + 0.8 + (2.9)
				埋込		
123	薬品注入設備 制御盤	K-7 後次亜注入機	CEE/F-S 1.25 sq - 4 c	P&D	5.6	(1.5)+ 1.5 + (2.6)
				RACK	10.6	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3 + 1.3
				CP	7.2	3.8 + 0.8 + (2.6)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	7.2	3.8 + 0.8 + (2.6)
				埋込		
124	薬品注入設備 制御盤	MV-1 1号 PAC貯蔵 槽引出弁	CEE/F 2 sq - 8 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	10.6	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3 + 1.3
				CP	6.3	3.4 + (2.9)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	6.3	3.4 + (2.9)
				埋込		
125	薬品注入設備 制御盤	MV-2 2号 PAC貯蔵 槽引出弁	CEE/F 2 sq - 8 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	8.0	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7
				CP	6.6	1.2 + 2.5 + (2.9)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	6.6	1.2 + 2.5 + (2.9)
				埋込		

(1)薬品注入設備盤（更新）（ 6/ 11）

拾い出し根拠表

[薬品注入設備（更新）]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
126	薬品注入設備 制御盤	MV-3 1号 苛性ソーダ貯蔵槽引出弁	CEE/F 2 sq - 8 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	7.9	3.7 + 3.8 + 0.4
				CP	3.6	0.7 + (2.9)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	3.6	0.7 + (2.9)
				埋込		
127	薬品注入設備 制御盤	MV-4 2号 苛性ソーダ貯蔵槽引出弁	CEE/F 2 sq - 8 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	10.0	3.7 + 3.8 + 0.4 + 1.7 + 0.4
				CP	3.6	0.7 + (2.9)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	3.6	0.7 + (2.9)
				埋込		
128	薬品注入設備 制御盤	MV-5 1号 次亜貯蔵槽引出弁	CEE/F 2 sq - 8 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	10.6	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3 + 1.3
				CP	7.8	3.8 + 1.1 + (2.9)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	7.8	3.8 + 1.1 + (2.9)
				埋込		
129	薬品注入設備 制御盤	MV-6 2号 次亜貯蔵槽引出弁	CEE/F 2 sq - 8 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	9.3	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3
				CP	8.2	3.8 + 1.1 + 0.4 + (2.9)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	8.2	3.8 + 1.1 + 0.4 + (2.9)
				埋込		
130	薬品注入設備 制御盤	LF-1 1号 PAC貯蔵槽電極（5P）	CEE/F 1.25 sq - 5 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	10.6	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3 + 1.3
				CP	5.1	3.4 + 0.7 + 0.8 + (0.2)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	5.1	3.4 + 0.7 + 0.8 + (0.2)
				埋込		

(1)薬品注入設備盤（更新）（ 7/ 11）

拾い出し根拠表

[薬品注入設備（更新）]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
131	薬品注入設備 制御盤	LF-2 2号 PAC貯蔵 槽電極（5 P ）	CEE/F 1.25 sq - 5 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	9.3	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3
				CP	5.3	1.2 + 3.9 + (0.2)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	5.3	1.2 + 3.9 + (0.2)
				埋込		
132	薬品注入設備 制御盤	LF-3 1号 苛性ソ ーダ貯蔵槽電 極（6 P）	CEE/F 1.25 sq - 6 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	7.9	3.7 + 3.8 + 0.4
				CP	2.4	1.9 + (0.5)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	2.4	1.9 + (0.5)
				埋込		
133	薬品注入設備 制御盤	LF-4 2号 苛性ソ ーダ貯蔵槽電 極（6 P）	CEE/F 1.25 sq - 6 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	10.0	3.7 + 3.8 + 0.4 + 1.7 + 0.4
				CP	2.4	1.9 + (0.5)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	2.4	1.9 + (0.5)
				埋込		
134	薬品注入設備 制御盤	LF-5 1号 次亜貯 蔵槽電極（5 P）	CEE/F 1.25 sq - 5 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	10.6	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3 + 1.3
				CP	7.4	3.8 + 1.1 + 0.8 + 1.5 + (0.2)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	7.4	3.8 + 1.1 + 0.8 + 1.5 + (0.2)
				埋込		
135	薬品注入設備 制御盤	LF-6 2号 次亜貯 蔵槽電極（5 P）	CEE/F 1.25 sq - 5 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	9.3	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3
				CP	7.8	3.8 + 1.1 + 0.8 + 1.9 + (0.2)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	7.8	3.8 + 1.1 + 0.8 + 1.9 + (0.2)
				埋込		

(1)薬品注入設備盤（更新）（ 8/ 11）

拾い出し根拠表

〔薬品注入設備（更新）〕

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
136	薬品注入設備 制御盤	LX-1 1号 PAC貯蔵 槽 変換器	600V CE/F 2 sq - 2 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	10.6	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3 + 1.3
				CP	5.9	3.4 + 0.7 + (1.8)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	22.4	5.9 + 10.6 + 5.9
			HIVE 22 mm	露出	5.9	3.4 + 0.7 + (1.8)
				埋込		
137	薬品注入設備 制御盤	LX-1 1号 PAC貯蔵 槽 変換器	CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	P&D	5.6	(1.5)+ 1.5 + (2.6)
				RACK	10.6	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3 + 1.3
				CP	5.6	3.4 + 0.7 + (1.5)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	5.6	3.4 + 0.7 + (1.5)
				埋込		
138	LX-1 1号 PAC貯蔵 槽 変換器	LT-1 1号 PAC貯蔵 槽液位計（検 出器）	専用ケーブル	P&D		
				RACK		
				CP	3.3	(1.8)+ 1.5
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	3.3	(1.8)+ 1.5
				埋込		
139	薬品注入設備 制御盤	LX-2 2号 PAC貯蔵 槽 変換器	600V CE/F 2 sq - 2 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	8.0	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7
				CP	6.2	1.2 + 2.5 + 0.7 + (1.8)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	20.1	5.9 + 8.0 + 6.2
			HIVE 22 mm	露出	6.2	1.2 + 2.5 + 0.7 + (1.8)
				埋込		
140	薬品注入設備 制御盤	LX-2 2号 PAC貯蔵 槽 変換器	CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	P&D	5.6	(1.5)+ 1.5 + (2.6)
				RACK	8.0	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7
				CP	5.9	1.2 + 2.5 + 0.7 + (1.5)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	5.9	1.2 + 2.5 + 0.7 + (1.5)
				埋込		

(1)薬品注入設備盤（更新）（ 9/ 11）

拾い出し根拠表

〔薬品注入設備（更新）〕

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
141	LX-2 2号 PAC貯蔵 槽 変換器	LT-2 2号 PAC貯蔵 槽液位計（検 出器）	専用ケーブル	P&D		
				RACK		
				CP	3.7	(1.8)+ 1.9
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	3.7	(1.8)+ 1.9
				埋込		
142	薬品注入設備 制御盤	LX-3 1号 苛性ソ ーダ貯蔵槽 変換器	600V CE/F 2 sq - 2 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	7.5	3.7 + 3.8
				CP	1.8	(1.8)
				FEP		
				CP	15.2	5.9 + 7.5 + 1.8
			HIVE 22 mm	露出	1.8	(1.8)
				埋込		
143	薬品注入設備 制御盤	LX-3 1号 苛性ソ ーダ貯蔵槽 変換器	CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	P&D	5.6	(1.5)+ 1.5 + (2.6)
				RACK	7.5	3.7 + 3.8
				CP	1.5	(1.5)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	1.5	(1.5)
				埋込		
144	LX-3 1号 苛性ソ ーダ貯蔵槽 変換器	LT-3 1号 苛性ソ ーダ貯蔵槽位 計（検出器）	専用ケーブル	P&D		
				RACK		
				CP	4.1	(1.5)+ 2.6
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	4.1	(1.5)+ 2.6
				埋込		
145	薬品注入設備 制御盤	LX-4 2号 苛性ソ ーダ貯蔵槽 変換器	600V CE/F 2 sq - 2 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	9.6	3.7 + 3.8 + 0.4 + 1.7
				CP	1.8	(1.8)
				FEP		
				CP	17.3	5.9 + 9.6 + 1.8
			HIVE 22 mm	露出	1.8	(1.8)
				埋込		

(1)薬品注入設備盤（更新）（ 10/ 11）

拾い出し根拠表

[薬品注入設備（更新）]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
146	薬品注入設備 制御盤	LX-4 2号 苛性ソーダ貯蔵槽 変換器	CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	P&D	5.6	(1.5)+ 1.5 + (2.6)
				RACK	9.6	3.7 + 3.8 + 0.4 + 1.7
				CP	1.5	(1.5)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	1.5	(1.5)
				埋込		
147	LX-4 1号 苛性ソーダ貯蔵槽 変換器	LT-4 2号 苛性ソーダ貯蔵槽液位計（検出器）	専用ケーブル	P&D		
				RACK		
				CP	4.1	(1.5)+ 2.6
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	4.1	(1.5)+ 2.6
				埋込		
148	薬品注入設備 制御盤	LX-5 1号 次亜貯蔵槽 変換器	600V CE/F 2 sq - 2 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	10.6	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3 + 1.3
				CP	7.5	3.8 + 1.1 + 0.8 + (1.8)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	24.0	5.9 + 10.6 + 7.5
			HIVE 22 mm	露出	7.5	3.8 + 1.1 + 0.8 + (1.8)
				埋込		
149	薬品注入設備 制御盤	LX-5 1号 次亜貯蔵槽 変換器	CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	P&D	5.6	(1.5)+ 1.5 + (2.6)
				RACK	10.6	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3 + 1.3
				CP	7.2	3.8 + 1.1 + 0.8 + (1.5)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	7.2	3.8 + 1.1 + 0.8 + (1.5)
				埋込		
150	LX-5 1号 次亜貯蔵槽 変換器	LT-5 1号 次亜貯蔵槽液位計（検出器）	専用ケーブル	P&D		
				RACK		
				CP	3.5	(1.8)+ 1.7
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	3.5	(1.8)+ 1.7
				埋込		

(1)薬品注入設備盤（更新）（11/ 11）

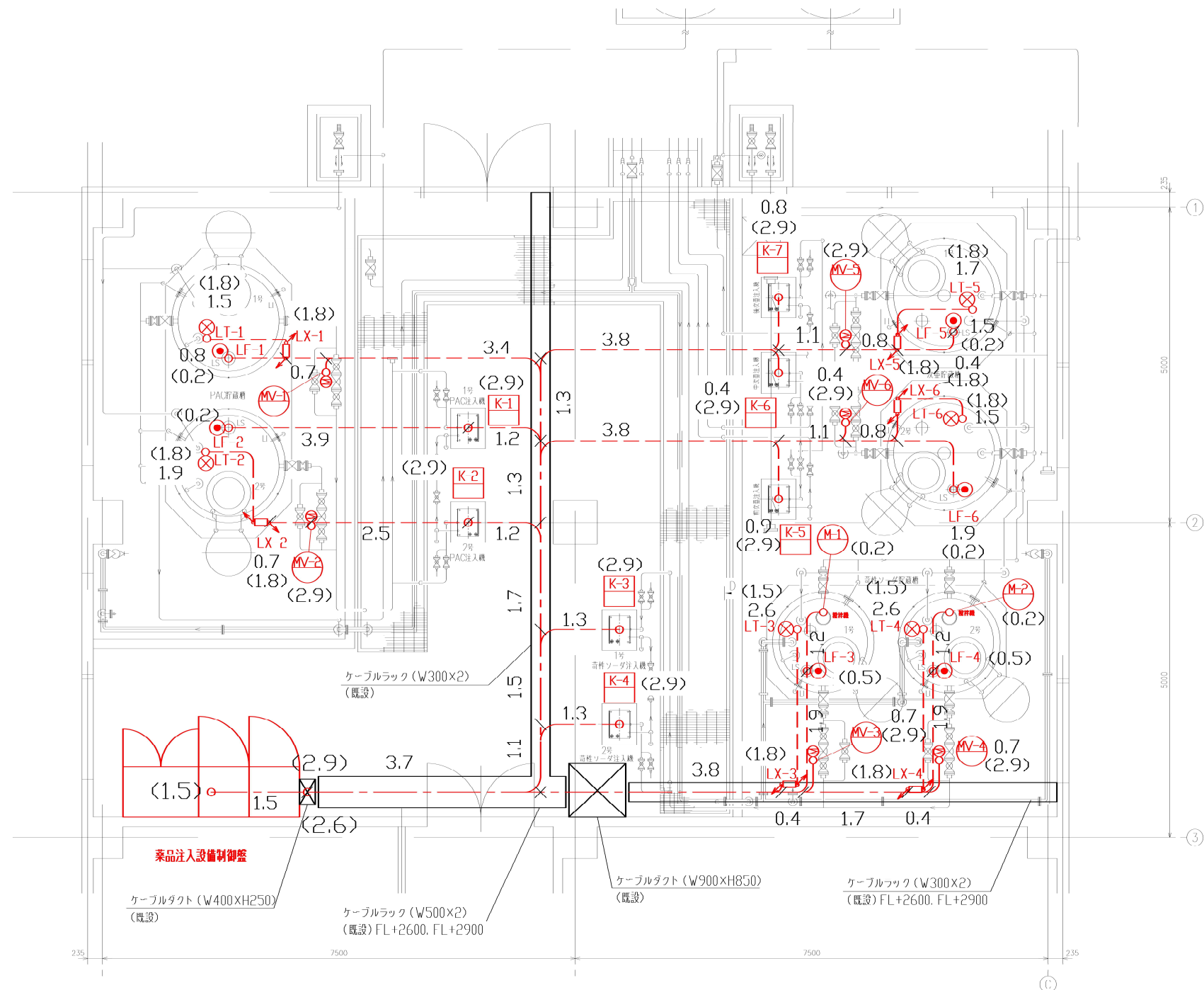
拾い出し根拠表

[薬品注入設備（更新）]

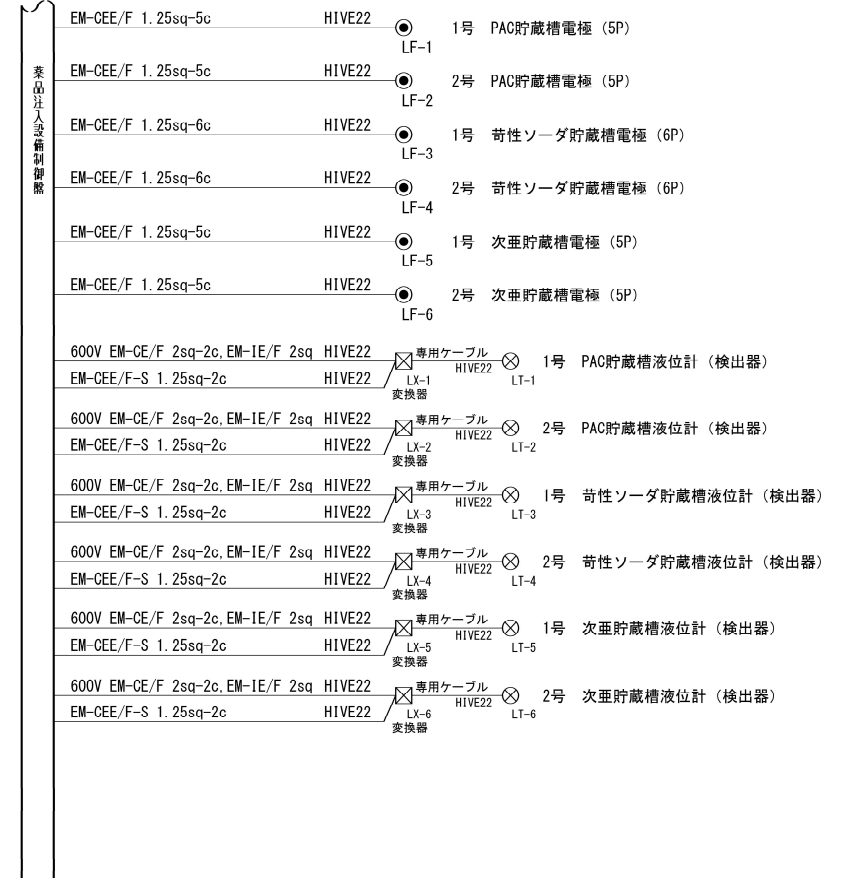
N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
151	薬品注入設備 制御盤	LX-6 2号 次亜貯 蔵槽 変換器	600V CE/F 2 sq - 2 c	P&D	5.9	(1.5)+ 1.5 + (2.9)
				RACK	9.3	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3
				CP	7.5	3.8 + 1.1 + 0.8 + (1.8)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	22.7	5.9 + 9.3 + 7.5
			HIVE 22 mm	露出	7.5	3.8 + 1.1 + 0.8 + (1.8)
				埋込		
152	薬品注入設備 制御盤	LX-6 2号 次亜貯 蔵槽 変換器	CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	P&D	5.6	(1.5)+ 1.5 + (2.6)
				RACK	9.3	3.7 + 1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.3
				CP	7.2	3.8 + 1.1 + 0.8 + (1.5)
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	7.2	3.8 + 1.1 + 0.8 + (1.5)
				埋込		
153	LX-6 2号 次亜貯 蔵槽 変換器	LT-6 2号 次亜貯 蔵槽液位計（ 検出器）	専用ケーブル	P&D		
				RACK		
				CP	3.3	(1.8)+ 1.5
				FEP		
				CP		
			HIVE 22 mm	露出	3.3	(1.8)+ 1.5
				埋込		
				P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
				CP		
				露出		
				埋込		
				P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
				CP		
				露出		
				埋込		







# 薬品注入設備配線系統図



附帯電気設備

仮設据付・撤去 数量計算書

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]



人工集計表

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

[illegible]

仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設一式）（ 1/ 1）

据 付 工 集 計 表

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	機器重量(t)		備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		単位重量	重量	
仮設PAC注入設備 制御盤	屋内自立 W800xD800xH2150	面	1		1.3		3.8								動力盤 1
仮設苛性ソーダ注入 設備制御盤	屋内自立 W800xD800xH2150	面	1		1.3		3.8								動力盤 1
仮設次亜注入設備 制御盤	屋内自立 W1200xD800xH2150	面	1		1.9		4.6								動力盤 3
仮設用分電盤	屋外自立 W600xD200xH600	面	1		0.88		1.9								現場操作盤 6
計 (S-901)				5.38		14.1									

仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設一式）（ 1/ 1）

試 験 工 集 計 表

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		
負荷試験	負荷試験	負荷	8	0.81	6.48								
ループ試験	ループ試験	ループ	8	0.6	4.8								
計 (T-901)				11.28									

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

電工量小計= 4.200

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

電工量小計= 5.225

材 料 集 計 表 - 3

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

[illegible]

C- 3 / 3

電工量小計= 15.676



[仮設薬注 据付・撤去 一式]

5-1-1



仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設一式）

材 料 内 訳 表

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

NO	配線区間 自 至		CEE/F				CEE/F-S				IE/F				IE/F				PF			
			1.25 sq				1.25 sq				3.5 sq				2 sq				54 mm			
			4 c				2 c															
			P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	露出	埋込		
501	分電盤	仮設PAC注入設															27.0					
502	仮設PAC注入設	KM-1															7.5					
503	仮設PAC注入設	KM-1	1.5		6.0																	
504	仮設PAC注入設	KM-1					1.5		6.0													
505	仮設PAC注入設	KM-2															8.5					
506	仮設PAC注入設	KM-2	1.5		7.0																	
507	仮設PAC注入設	KM-2					1.5		7.0													
508	仮設PAC注入設	KLF-1	1.5		10.1																	
511	分電盤	仮設PACハウス											31.2									
512	分電盤	仮設苛性ソー															18.6					
513	仮設苛性ソー	KM-3															7.5					
514	仮設苛性ソー	KM-3	1.5		6.0																	
515	仮設苛性ソー	KM-3					1.5		6.0													
516	仮設苛性ソー	KM-4															8.5					
517	仮設苛性ソー	KM-4	1.5		7.0																	
518	仮設苛性ソー	KM-4					1.5		7.0													
519	仮設苛性ソー	KLF-2	1.5		10.1																	
522	分電盤	仮設苛性ハウ											22.8									
523	分電盤	次亜注入設備															9.9					
524	仮設次亜注入	KM-5															8.9					
525	仮設次亜注入	KM-5	1.5		7.4																	
526	仮設次亜注入	KM-5					1.5		7.4													
527	仮設次亜注入	KM-6															9.6					
528	仮設次亜注入	KM-6	1.5		8.1																	
529	仮設次亜注入	KM-6					1.5		8.1													
530	仮設次亜注入	KM-7															7.4					
531	仮設次亜注入	KM-7	1.5		5.9																	
532	仮設次亜注入	KM-7					1.5		5.9													
533	仮設次亜注入	KM-8															8.1					
534	仮設次亜注入	KM-8	1.5		6.6																	
535	仮設次亜注入	KM-8					1.5		6.6													
536	仮設次亜注入	KLF-3	1.5		9.9																	
538	仮設次亜注入	PB																	4.0			
540	分電盤	仮設次亜ハウ															14.4					
( 2/3)	CHK ( 9- 2)		16.5		84.1		12.0		54.0				54.0				135.9		4.0			

仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設一式）

材 料 内 訳 表

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

NO	配線区間 自 至		PF 42 mm				PF 36 mm				PF 28 mm				PF 22 mm							
			露出	埋込			露出	埋込			露出	埋込			露出	埋込						
501	分電盤	仮設PAC注入設									24.0											
502	仮設PAC注入設	KM-1													1.9							
503	仮設PAC注入設	KM-1													1.9							
504	仮設PAC注入設	KM-1													1.9							
505	仮設PAC注入設	KM-2													2.9							
506	仮設PAC注入設	KM-2													2.9							
507	仮設PAC注入設	KM-2													2.9							
508	仮設PAC注入設	KLF-1													6.0							
509	仮設PAC注入設	PB					4.1															
510	仮設PAC注入設	PB									4.1x2											
511	分電盤	仮設PACハウス					28.2															
512	分電盤	仮設苛性ソー									15.6											
513	仮設苛性ソー	KM-3													1.9							
514	仮設苛性ソー	KM-3													1.9							
515	仮設苛性ソー	KM-3													1.9							
516	仮設苛性ソー	KM-4													2.9							
517	仮設苛性ソー	KM-4													2.9							
518	仮設苛性ソー	KM-4													2.9							
519	仮設苛性ソー	KLF-2													6.0							
520	仮設苛性ソー	PB					4.1															
521	仮設苛性ソー	PB									4.1x2											
522	分電盤	仮設苛性ハウ									19.8											
523	分電盤	次亜注入設備									6.9											
524	仮設次亜注入	KM-5													3.4							
525	仮設次亜注入	KM-5													3.4							
526	仮設次亜注入	KM-5													3.4							
527	仮設次亜注入	KM-6													4.1							
528	仮設次亜注入	KM-6													4.1							
529	仮設次亜注入	KM-6													4.1							
530	仮設次亜注入	KM-7													1.9							
531	仮設次亜注入	KM-7													1.9							
532	仮設次亜注入	KM-7													1.9							
533	仮設次亜注入	KM-8													2.6							
534	仮設次亜注入	KM-8													2.6							
535	仮設次亜注入	KM-8													2.6							
536	仮設次亜注入	KLF-3													5.9							
539	仮設次亜注入	PB	4.0x2																			
540	分電盤	仮設次亜ハウ													11.4							
( 3/3)	CHK ( 9- 3)		8.0				36.4				82.7				94.1							



仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設一式）（ 1/ 8）

拾い出し根拠表

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
501	分電盤	仮設PAC注入 設備制御盤	600V CE/F 5.5 sq - 2 c	P&D	3.0	(1.5)+ (1.5)
				RACK		
				CP	24.0	5.9 + 1.4 + 7.3 + 1.1 + 7.3 + 1.0
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	27.0	3.0 + 24.0
			PF 28 mm	露出	24.0	5.9 + 1.4 + 7.3 + 1.1 + 7.3 + 1.0
				埋込		
502	仮設PAC注入 設備制御盤	KM-1 No.1 仮設P AC注入ポンプ	600V CE/F 2 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	6.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 0.6 + (0.5)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	7.5	1.5 + 6.0
			PF 22 mm	露出	1.9	0.8 + 0.6 + (0.5)
				埋込		
503	仮設PAC注入 設備制御盤	KM-1 No.1 仮設P AC注入ポンプ	CEE/F 1.25 sq - 4 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	6.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 0.6 + (0.5)
				FEP		
				CP		
			PF 22 mm	露出	1.9	0.8 + 0.6 + (0.5)
				埋込		
504	仮設PAC注入 設備制御盤	KM-1 No.1 仮設P AC注入ポンプ	CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	6.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 0.6 + (0.5)
				FEP		
				CP		
			PF 22 mm	露出	1.9	0.8 + 0.6 + (0.5)
				埋込		
505	仮設PAC注入 設備制御盤	KM-2 No.2 仮設P AC注入ポンプ	600V CE/F 2 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	7.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	8.5	1.5 + 7.0
			PF 22 mm	露出	2.9	0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)
				埋込		

仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設一式）（ 2/ 8）

拾い出し根拠表

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
506	仮設PAC注入 設備制御盤	KM-2 No. 2 仮設P AC注入ポンプ	CEE/F 1.25 sq - 4 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	7.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	2.9	0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)
				埋込		
507	仮設PAC注入 設備制御盤	KM-2 No. 2 仮設P AC注入ポンプ	CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	7.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	2.9	0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)
				埋込		
508	仮設PAC注入 設備制御盤	KLF-1 仮設PAC貯蔵 槽電極（4P）	CEE/F 1.25 sq - 4 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	10.1	0.6 + 3.5 + 0.8 + 1.0 + 0.6 + (3.0)+ 0.6
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	6.0	0.8 + 1.0 + 0.6 + (3.0)+ 0.6
				埋込		
509	仮設PAC注入 設備制御盤	PB PB		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
			PF 36 mm	CP		
				露出	4.1	0.6 + 3.5
				埋込		
510	仮設PAC注入 設備制御盤	PB PB		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
			PF 28 mm x 2	CP		
				露出	4.1	0.6 + 3.5
				埋込		

仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設一式）（ 3/ 8）

拾い出し根拠表

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
511	分電盤	仮設PACハウス（電灯盤）	600V CE/F 14 sq - 2 c	P&D	3.0	(1.5) + (1.5)
				RACK		
				CP	28.2	5.9 + 1.4 + 7.3 + 1.1 + 7.3 + 1.1 + 3.5 + 0.6
				FEP		
			IE/F 3.5 sq	CP	31.2	3.0 + 28.2
			PF 36 mm	露出	28.2	5.9 + 1.4 + 7.3 + 1.1 + 7.3 + 1.1 + 3.5 + 0.6
				埋込		
512	分電盤	仮設苛性ソーダ注入設備制御盤	600V CE/F 5.5 sq - 2 c	P&D	3.0	(1.5) + (1.5)
				RACK		
				CP	15.6	5.9 + 1.4 + 7.3 + 1.0
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	18.6	3.0 + 15.6
			PF 28 mm	露出	15.6	5.9 + 1.4 + 7.3 + 1.0
				埋込		
513	仮設苛性ソーダ注入設備制御盤	KM-3 No.1 仮設苛性ソーダ注入ポンプ	600V CE/F 2 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	6.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 0.6 + (0.5)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	7.5	1.5 + 6.0
			PF 22 mm	露出	1.9	0.8 + 0.6 + (0.5)
				埋込		
514	仮設苛性ソーダ注入設備制御盤	KM-3 No.1 仮設苛性ソーダ注入ポンプ	CEE/F 1.25 sq - 4 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	6.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 0.6 + (0.5)
				FEP		
				CP		
			PF 22 mm	露出	1.9	0.8 + 0.6 + (0.5)
				埋込		
515	仮設苛性ソーダ注入設備制御盤	KM-3 No.1 仮設苛性ソーダ注入ポンプ	CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	6.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 0.6 + (0.5)
				FEP		
				CP		
			PF 22 mm	露出	1.9	0.8 + 0.6 + (0.5)
				埋込		

仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設一式）（ 4/ 8）

拾い出し根拠表

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
516	仮設苛性ソーダ注入設備制御盤	KM-4 No.2 仮設苛性ソーダ注入ポンプ	600V CE/F 2 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	7.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	8.5	1.5 + 7.0
			PF 22 mm	露出	2.9	0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)
				埋込		
517	仮設苛性ソーダ注入設備制御盤	KM-4 No.2 仮設苛性ソーダ注入ポンプ	CEE/F 1.25 sq - 4 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	7.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)
				FEP		
				CP		
			PF 22 mm	露出	2.9	0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)
				埋込		
518	仮設苛性ソーダ注入設備制御盤	KM-4 No.2 仮設苛性ソーダ注入ポンプ	CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	7.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)
				FEP		
				CP		
			PF 22 mm	露出	2.9	0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)
				埋込		
519	仮設苛性ソーダ注入設備制御盤	KLF-2 仮設苛性ソーダ貯蔵槽電極(4P)	CEE/F 1.25 sq - 4 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	10.1	0.6 + 3.5 + 0.8 + 1.0 + 0.6 + (3.0) + 0.6
				FEP		
				CP		
			PF 22 mm	露出	6.0	0.8 + 1.0 + 0.6 + (3.0) + 0.6
				埋込		
520	仮設苛性ソーダ注入設備制御盤	PB PB		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
				CP		
			PF 36 mm	露出	4.1	0.6 + 3.5
				埋込		

仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設一式）（ 5/ 8）

拾い出し根拠表

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
521	仮設苛性ソーダ注入設備制御盤	PB		P&D		
		PB		RACK		
				CP		
				FEP		
				CP		
				露出	4.1	0.6 + 3.5
				埋込		
522	分電盤	仮設苛性ハウス（電灯盤）	600V CE/F 8 sq - 2 c	P&D	3.0	(1.5) + (1.5)
				RACK		
				CP	19.8	5.9 + 1.4 + 7.3 + 1.1 + 3.5 + 0.6
				FEP		
				CP	22.8	3.0 + 19.8
				露出	19.8	5.9 + 1.4 + 7.3 + 1.1 + 3.5 + 0.6
				埋込		
523	分電盤	次亜注入設備制御盤	600V CE/F 5.5 sq - 2 c	P&D	3.0	(1.5) + (1.5)
				RACK		
				CP	6.9	5.9 + 1.0
				FEP		
				CP	9.9	3.0 + 6.9
				露出	6.9	5.9 + 1.0
				埋込		
524	仮設次亜注入設備制御盤	No.1 仮設前次亜注入ポンプ	600V CE/F 2 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	7.4	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
				CP	8.9	1.5 + 7.4
				露出	3.4	0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + (0.5)
				埋込		
525	仮設次亜注入設備制御盤	No.1 仮設前次亜注入ポンプ	CEE/F 1.25 sq - 4 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	7.4	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
				CP		
				露出	3.4	0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + (0.5)
				埋込		



仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設一式）（ 6/ 8）

拾い出し根拠表

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
526	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-5 No.1 仮設 前次亜注入 ポンプ	CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	7.4	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	3.4	0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + (0.5)
527	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-6 No.2 仮設 前次亜注入 ポンプ	600V CE/F 2 sq - 2 c	埋込		
				P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	8.1	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	9.6	1.5 + 8.1
528	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-6 No.2 仮設 前次亜注入 ポンプ	CEE/F 1.25 sq - 4 c	露出	4.1	0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				埋込		
				P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
			PF 22 mm	CP	8.1	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
529	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-6 No.2 仮設 前次亜注入 ポンプ	CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	CP		
				露出	4.1	0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				埋込		
				RACK		
			PF 22 mm	CP	8.1	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
530	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-7 No.1 仮設 後次亜注入 ポンプ	600V CE/F 2 sq - 2 c	CP		
				露出	4.1	0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				埋込		
				RACK		
			IE/F 2 sq	CP	5.9	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
530	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-7 No.1 仮設 後次亜注入 ポンプ	PF 22 mm	CP	7.4	1.5 + 5.9
				露出	1.9	0.7 + 0.7 + (0.5)
				埋込		
				RACK		
			PF 22 mm	CP		
				FEP		

仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設一式）（ 7/ 8）

拾い出し根拠表

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
531	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-7 No.1 仮設 後次亜注入 ポンプ	CEE/F 1.25 sq - 4 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	5.9	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	1.9	0.7 + 0.7 + (0.5)
				埋込		
532	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-7 No.1 仮設 後次亜注入 ポンプ	CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	5.9	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	1.9	0.7 + 0.7 + (0.5)
				埋込		
533	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-8 No.2 仮設 後次亜注入 ポンプ	600V CE/F 2 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	6.6	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	8.1	1.5 + 6.6
			PF 22 mm	露出	2.6	0.7 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				埋込		
534	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-8 No.2 仮設 後次亜注入 ポンプ	CEE/F 1.25 sq - 4 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	6.6	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	2.6	0.7 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				埋込		
535	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-8 No.2 仮設 後次亜注入 ポンプ	CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	6.6	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	2.6	0.7 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				埋込		

仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設一式）（ 8/ 8）

拾い出し根拠表

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
536	仮設次亜注入 設備制御盤	KLF-3 仮設次亜貯蔵 槽電極（4P）	CEE/F 1.25 sq - 4 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	9.9	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.3 + (3.0)+ 0.6
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	5.9	0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.3 + (3.0)+ 0.6
				埋込		
538	仮設次亜注入 設備制御盤	PB PB		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
			PF 54 mm	CP		
				露出	4.0	0.6 + 3.4
				埋込		
539	仮設次亜注入 設備制御盤	PB PB		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
			PF 42 mm x 2	CP		
				露出	4.0	0.6 + 3.4
				埋込		
540	分電盤	仮設次亜ハウ ス（電灯盤）	600V CE/F 3.5 sq - 2 c	P&D	3.0	(1.5)+ (1.5)
				RACK		
				CP	11.4	5.9 + 1.4 + 3.5 + 0.6
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	14.4	3.0 + 11.4
			PF 22 mm	露出	11.4	5.9 + 1.4 + 3.5 + 0.6
				埋込		
				P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
				CP		
				露出		
				埋込		

仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設一式）（ 1/ 1）

## 設備材料一覽表

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

[illegible]

仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設撤去一式）（ 1/ 1）

（撤 去）据 付 工 集 計 表

〔仮設薬注 据付・撤去 一式〕

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	機器重量(t)		備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		単位重量	重量	
仮設PAC注入設備制御盤	屋内自立 W800xD800xH2150	面	1	1.3*0.4 =0.52	# 0.52	3.8*0.4 =1.5	1.5								動力盤 1
仮設苛性ソーダ注入設備制御盤	屋内自立 W800xD800xH2150	面	1	1.3*0.4 =0.52	# 0.52	3.8*0.4 =1.5	1.5								動力盤 1
仮設次亜注入設備制御盤	屋内自立 W1200xD800xH2150	面	1	1.9*0.4 =0.76	# 0.76	4.6*0.4 =1.8	1.8								動力盤 3
仮設用分電盤	屋外自立 W600xD200xH600	面	1	0.88*0.4 =0.35	# 0.35	1.9*0.4 =0.76	0.76								現場操作盤 6
計 (S-1701)				# 2.15	--->	2.15	+	5.56							
								7.71							

#印は再使用しない撤去なので技術者を電 工に読み替える

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

C- 1 / 3 (K= 0.4) 電工量小計= 1.570

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

C- 2 / 3 (K= 0.4) 電工量小計= 1.997

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

C- 3 / 3 (K= 0.4) 電工量小計= 6.116





[仮設薬注 据付・撤去 一式]

( 1/3)	CRK (17- 1)	3.0		28.2		3.0		19.8		9.0		46.5		3.0		11.4		12.0		54.0	
--------	-------------	-----	--	------	--	-----	--	------	--	-----	--	------	--	-----	--	------	--	------	--	------	--

仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設撤去一式）

（撤 去）材 料 内 訳 表

〔仮設薬注 据付・撤去 一式〕

NO	配線区間 自 至		CEE/F				CEE/F-S				IE/F				IE/F				PF			
			1.25 sq				1.25 sq				3.5 sq				2 sq				54 mm			
			4 c				2 c															
			P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	露出	埋込		
R 901	分電盤	仮設PAC注入設															27.0					
R 902	仮設PAC注入設	KM-1															7.5					
R 903	仮設PAC注入設	KM-1	1.5		6.0																	
R 904	仮設PAC注入設	KM-1					1.5		6.0													
R 905	仮設PAC注入設	KM-2															8.5					
R 906	仮設PAC注入設	KM-2	1.5		7.0																	
R 907	仮設PAC注入設	KM-2					1.5		7.0													
R 908	仮設PAC注入設	KLF-1	1.5		10.1																	
R 911	分電盤	仮設PACハウス											31.2									
R 912	分電盤	仮設苛性ソー															18.6					
R 913	仮設苛性ソー	KM-3															7.5					
R 914	仮設苛性ソー	KM-3	1.5		6.0																	
R 915	仮設苛性ソー	KM-3					1.5		6.0													
R 916	仮設苛性ソー	KM-4															8.5					
R 917	仮設苛性ソー	KM-4	1.5		7.0																	
R 918	仮設苛性ソー	KM-4					1.5		7.0													
R 919	仮設苛性ソー	KLF-2	1.5		10.1																	
R 922	分電盤	仮設苛性ハウ											22.8									
R 923	分電盤	次亜注入設備															9.9					
R 924	仮設次亜注入	KM-5															8.9					
R 925	仮設次亜注入	KM-5	1.5		7.4																	
R 926	仮設次亜注入	KM-5					1.5		7.4													
R 927	仮設次亜注入	KM-6															9.6					
R 928	仮設次亜注入	KM-6	1.5		8.1																	
R 929	仮設次亜注入	KM-6					1.5		8.1													
R 930	6	KM-7															7.4					
R 931	仮設次亜注入	KM-7	1.5		5.9																	
R 932	仮設次亜注入	KM-7					1.5		5.9													
R 933	仮設次亜注入	KM-8															8.1					
R 934	仮設次亜注入	KM-8	1.5		6.6																	
R 935	仮設次亜注入	KM-8					1.5		6.6													
R 936	仮設次亜注入	KLF-3	1.5		9.9																	
R 938	仮設次亜注入	PB																	4.0			
R 940	分電盤	仮設次亜ハウ															14.4					
( 2/3)	CRK (17- 2)		16.5		84.1		12.0		54.0				54.0				135.9		4.0			

仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設撤去一式）

（撤 去）材 料 内 訳 表

〔仮設薬注 据付・撤去 一式〕

NO	配線区間 自 至		PF 42 mm				PF 36 mm				PF 28 mm				PF 22 mm							
			露出	埋込			露出	埋込			露出	埋込			露出	埋込						
R 901	分電盤	仮設PAC注入設									24.0											
R 902	仮設PAC注入設	KM-1													1.9							
R 903	仮設PAC注入設	KM-1													1.9							
R 904	仮設PAC注入設	KM-1													1.9							
R 905	仮設PAC注入設	KM-2													2.9							
R 906	仮設PAC注入設	KM-2													2.9							
R 907	仮設PAC注入設	KM-2													2.9							
R 908	仮設PAC注入設	KLF-1													6.0							
R 909	仮設PAC注入設	PB					4.1															
R 910	仮設PAC注入設	PB									4.1x2											
R 911	分電盤	仮設PACハウス					28.2															
R 912	分電盤	仮設苛性ソー									15.6											
R 913	仮設苛性ソー	KM-3													1.9							
R 914	仮設苛性ソー	KM-3													1.9							
R 915	仮設苛性ソー	KM-3													1.9							
R 916	仮設苛性ソー	KM-4													2.9							
R 917	仮設苛性ソー	KM-4													2.9							
R 918	仮設苛性ソー	KM-4													2.9							
R 919	仮設苛性ソー	KLF-2													6.0							
R 920	仮設苛性ソー	PB					4.1															
R 921	仮設苛性ソー	PB									4.1x2											
R 922	分電盤	仮設苛性ハウ									19.8											
R 923	分電盤	次亜注入設備									6.9											
R 924	仮設次亜注入	KM-5													3.4							
R 925	仮設次亜注入	KM-5													3.4							
R 926	仮設次亜注入	KM-5													3.4							
R 927	仮設次亜注入	KM-6													4.1							
R 928	仮設次亜注入	KM-6													4.1							
R 929	仮設次亜注入	KM-6													4.1							
R 930	6	KM-7													1.9							
R 931	仮設次亜注入	KM-7													1.9							
R 932	仮設次亜注入	KM-7													1.9							
R 933	仮設次亜注入	KM-8													2.6							
R 934	仮設次亜注入	KM-8													2.6							
R 935	仮設次亜注入	KM-8													2.6							
R 936	仮設次亜注入	KLF-3													5.9							
R 939	仮設次亜注入	PB	4.0x2																			
R 940	分電盤	仮設次亜ハウ													11.4							
( 3/3)	CRK (17- 3)		8.0				36.4				82.7				94.1							



仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設撤去一式）（ 1/ 8）

拾い出し根拠表

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
R 901	分電盤	仮設PAC注入 設備制御盤	600V CE/F 5.5 sq - 2 c	P&D	3.0	(1.5)+ (1.5)
				RACK		
				CP	24.0	5.9 + 1.4 + 7.3 + 1.1 + 7.3 + 1.0
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	27.0	3.0 + 24.0
			PF 28 mm	露出	24.0	5.9 + 1.4 + 7.3 + 1.1 + 7.3 + 1.0
R 902	仮設PAC注入 設備制御盤	KM-1 No.1 仮設P AC注入ポンプ	600V CE/F 2 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	6.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 0.6 + (0.5)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	7.5	1.5 + 6.0
			PF 22 mm	露出	1.9	0.8 + 0.6 + (0.5)
R 903	仮設PAC注入 設備制御盤	KM-1 No.1 仮設P AC注入ポンプ	CEE/F 1.25 sq - 4 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	6.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 0.6 + (0.5)
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	1.9	0.8 + 0.6 + (0.5)
R 904	仮設PAC注入 設備制御盤	KM-1 No.1 仮設P AC注入ポンプ	CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	6.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 0.6 + (0.5)
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	1.9	0.8 + 0.6 + (0.5)
R 905	仮設PAC注入 設備制御盤	KM-2 No.2 仮設P AC注入ポンプ	600V CE/F 2 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	7.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	8.5	1.5 + 7.0
			PF 22 mm	露出	2.9	0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)
				埋込		

仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設撤去一式）（ 2/ 8）

拾い出し根拠表

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
R 906	仮設PAC注入 設備制御盤	KM-2 No. 2 仮設P AC注入ポンプ	CEE/F 1.25 sq - 4 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	7.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	2.9	0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)
				埋込		
R 907	仮設PAC注入 設備制御盤	KM-2 No. 2 仮設P AC注入ポンプ	CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	7.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	2.9	0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)
				埋込		
R 908	仮設PAC注入 設備制御盤	KLF-1 仮設PAC貯蔵 槽電極（4P）	CEE/F 1.25 sq - 4 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	10.1	0.6 + 3.5 + 0.8 + 1.0 + 0.6 + (3.0)+ 0.6
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	6.0	0.8 + 1.0 + 0.6 + (3.0)+ 0.6
				埋込		
R 909	仮設PAC注入 設備制御盤	PB PB		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
			PF 36 mm	CP		
				露出	4.1	0.6 + 3.5
				埋込		
R 910	仮設PAC注入 設備制御盤	PB PB		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
			PF 28 mm x 2	CP		
				露出	4.1	0.6 + 3.5
				埋込		

仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設撤去一式）（ 3/ 8）

拾い出し根拠表

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
R 911	分電盤	仮設PACハウス（電灯盤）	600V CE/F 14 sq - 2 c	P&D	3.0	(1.5)+ (1.5)
				RACK		
				CP	28.2	5.9 + 1.4 + 7.3 + 1.1 + 7.3 + 1.1 + 3.5 + 0.6
				FEP		
			IE/F 3.5 sq	CP	31.2	3.0 + 28.2
			PF 36 mm	露出	28.2	5.9 + 1.4 + 7.3 + 1.1 + 7.3 + 1.1 + 3.5 + 0.6
R 912	分電盤	仮設苛性ソーダ注入設備制御盤	600V CE/F 5.5 sq - 2 c	P&D	3.0	(1.5)+ (1.5)
				RACK		
				CP	15.6	5.9 + 1.4 + 7.3 + 1.0
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	18.6	3.0 + 15.6
			PF 28 mm	露出	15.6	5.9 + 1.4 + 7.3 + 1.0
R 913	仮設苛性ソーダ注入設備制御盤	KM-3 No.1 仮設苛性ソーダ注入ポンプ	600V CE/F 2 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	6.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 0.6 + (0.5)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	7.5	1.5 + 6.0
			PF 22 mm	露出	1.9	0.8 + 0.6 + (0.5)
R 914	仮設苛性ソーダ注入設備制御盤	KM-3 No.1 仮設苛性ソーダ注入ポンプ	CEE/F 1.25 sq - 4 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	6.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 0.6 + (0.5)
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	1.9	0.8 + 0.6 + (0.5)
R 915	仮設苛性ソーダ注入設備制御盤	KM-3 No.1 仮設苛性ソーダ注入ポンプ	CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	6.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 0.6 + (0.5)
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	1.9	0.8 + 0.6 + (0.5)



仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設撤去一式）（ 4/ 8）				拾い出し根拠表		[仮設薬注 据付・撤去 一式]	
N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算	
R 916	仮設苛性ソーダ注入設備制御盤	KM-4 No.2 仮設苛性ソーダ注入ポンプ	600V CE/F 2 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)	
				RACK			
				CP	7.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)	
				FEP			
			IE/F 2 sq	CP	8.5	1.5 + 7.0	
			PF 22 mm	露出	2.9	0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)	
R 917	仮設苛性ソーダ注入設備制御盤	KM-4 No.2 仮設苛性ソーダ注入ポンプ	CEE/F 1.25 sq - 4 c	P&D	1.5	(1.5)	
				RACK			
				CP	7.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)	
				FEP			
				CP			
			PF 22 mm	露出	2.9	0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)	
R 918	仮設苛性ソーダ注入設備制御盤	KM-4 No.2 仮設苛性ソーダ注入ポンプ	CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)	
				RACK			
				CP	7.0	0.6 + 3.5 + 0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)	
				FEP			
				CP			
			PF 22 mm	露出	2.9	0.8 + 1.0 + 0.6 + (0.5)	
R 919	仮設苛性ソーダ注入設備制御盤	KLF-2 仮設苛性ソーダ貯蔵槽電極(4P)	CEE/F 1.25 sq - 4 c	P&D	1.5	(1.5)	
				RACK			
				CP	10.1	0.6 + 3.5 + 0.8 + 1.0 + 0.6 + (3.0)+ 0.6	
				FEP			
				CP			
			PF 22 mm	露出	6.0	0.8 + 1.0 + 0.6 + (3.0)+ 0.6	
R 920	仮設苛性ソーダ注入設備制御盤	PB PB		P&D			
				RACK			
				CP			
				FEP			
				CP			
			PF 36 mm	露出	4.1	0.6 + 3.5	
				埋込			

仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設撤去一式）（ 5/ 8）

拾い出し根拠表

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
R 921	仮設苛性ソーダ注入設備制御盤	PB		P&D		
		PB		RACK		
				CP		
				FEP		
				CP		
				露出	4.1	0.6 + 3.5
				埋込		
R 922	分電盤	仮設苛性ハウス（電灯盤）	600V CE/F 8 sq - 2 c	P&D	3.0	(1.5)+ (1.5)
				RACK		
				CP	19.8	5.9 + 1.4 + 7.3 + 1.1 + 3.5 + 0.6
				FEP		
				CP	22.8	3.0 + 19.8
				露出	19.8	5.9 + 1.4 + 7.3 + 1.1 + 3.5 + 0.6
				埋込		
R 923	分電盤	次亜注入設備制御盤	600V CE/F 5.5 sq - 2 c	P&D	3.0	(1.5)+ (1.5)
				RACK		
				CP	6.9	5.9 + 1.0
				FEP		
				CP	9.9	3.0 + 6.9
				露出	6.9	5.9 + 1.0
				埋込		
R 924	仮設次亜注入設備制御盤	No.1 仮設前次亜注入ポンプ	600V CE/F 2 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	7.4	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
				CP	8.9	1.5 + 7.4
				露出	3.4	0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + (0.5)
				埋込		
R 925	仮設次亜注入設備制御盤	No.1 仮設前次亜注入ポンプ	CEE/F 1.25 sq - 4 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	7.4	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
				CP		
				露出	3.4	0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + (0.5)
				埋込		

仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設撤去一式）（ 6/ 8）

拾い出し根拠表

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
R 926	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-5 No.1 仮設 前次亜注入 ポンプ	CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	7.4	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	3.4	0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + (0.5)
R 927	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-6 No.2 仮設 前次亜注入 ポンプ	600V CE/F 2 sq - 2 c	埋込		
				P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	8.1	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	9.6	1.5 + 8.1
R 928	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-6 No.2 仮設 前次亜注入 ポンプ	PF 22 mm	露出	4.1	0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				埋込		
			CEE/F 1.25 sq - 4 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	8.1	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
R 929	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-6 No.2 仮設 前次亜注入 ポンプ	PF 22 mm	CP		
				露出	4.1	0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
			CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	埋込		
				P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	8.1	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.2 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
R 930	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-7 No.1 仮設 後次亜注入 ポンプ	600V CE/F 2 sq - 2 c	FEP		
				CP		
				CP	5.9	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				RACK		
			IE/F 2 sq	CP	7.4	1.5 + 5.9
			PF 22 mm	露出	1.9	0.7 + 0.7 + (0.5)
R 930	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-7 No.1 仮設 後次亜注入 ポンプ	PF 22 mm	埋込		
				露出	1.9	0.7 + 0.7 + (0.5)
			600V CE/F 2 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	5.9	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				FEP		

仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設撤去一式）（ 7/ 8）

拾い出し根拠表

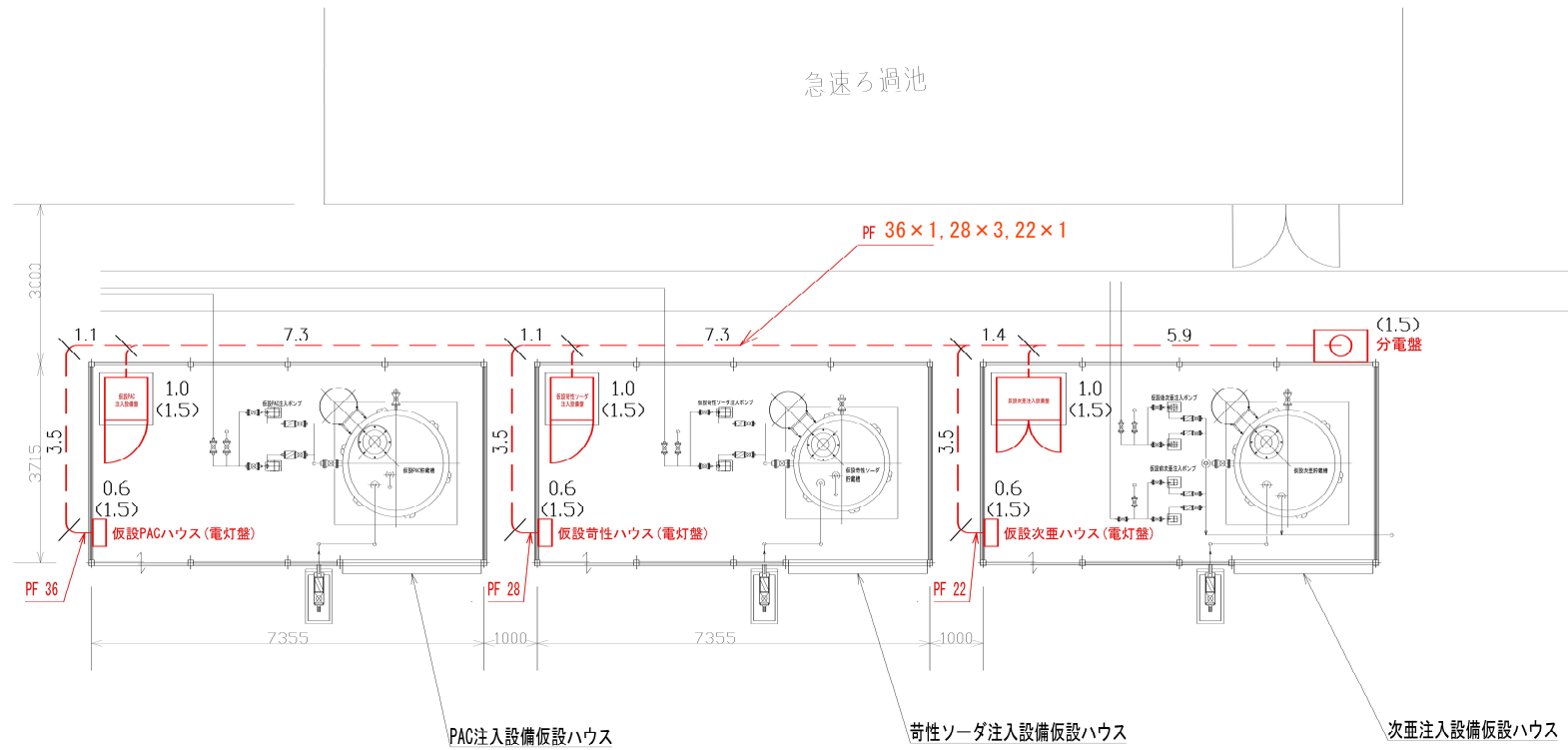
[仮設薬注 据付・撤去 一式]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
R 931	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-7 No.1 仮設 後次亜注入 ポンプ	CEE/F 1.25 sq - 4 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	5.9	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	1.9	0.7 + 0.7 + (0.5)
				埋込		
R 932	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-7 No.1 仮設 後次亜注入 ポンプ	CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	5.9	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	1.9	0.7 + 0.7 + (0.5)
				埋込		
R 933	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-8 No.2 仮設 後次亜注入 ポンプ	600V CE/F 2 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	6.6	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
			IE/F 2 sq	CP	8.1	1.5 + 6.6
			PF 22 mm	露出	2.6	0.7 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				埋込		
R 934	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-8 No.2 仮設 後次亜注入 ポンプ	CEE/F 1.25 sq - 4 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	6.6	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	2.6	0.7 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				埋込		
R 935	仮設次亜注入 設備制御盤	KM-8 No.2 仮設 後次亜注入 ポンプ	CEE/F-S 1.25 sq - 2 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	6.6	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	2.6	0.7 + 0.7 + 0.7 + (0.5)
				埋込		

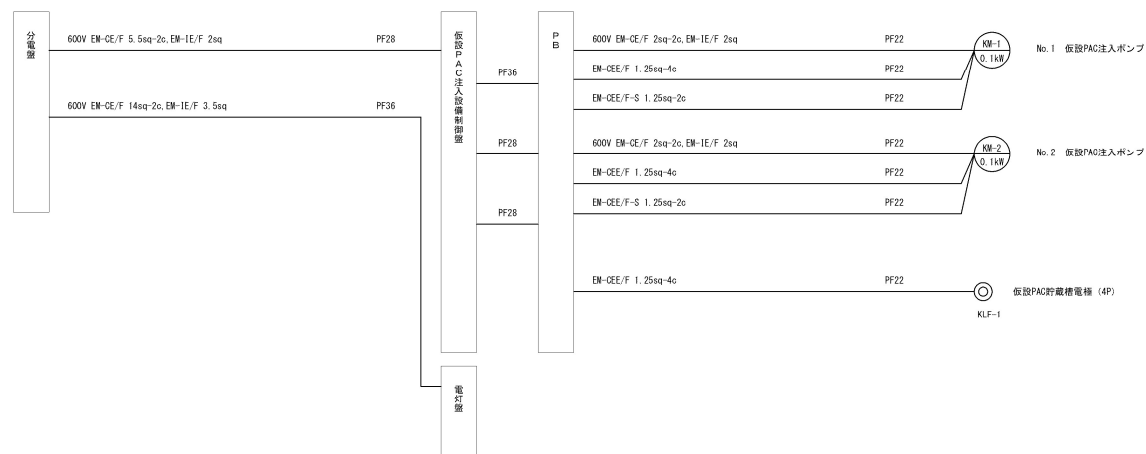
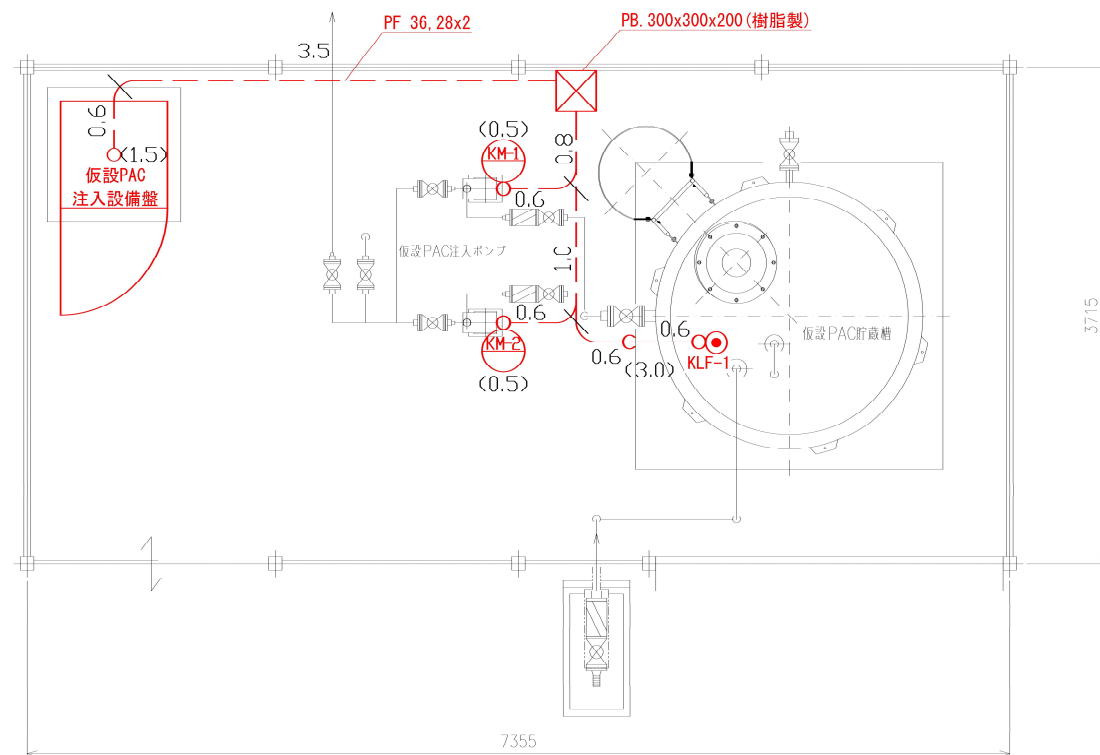
仮設PAC・仮設苛性ソーダ・仮設次亜（仮設撤去一式）（ 8/ 8）				拾い出し根拠表		[仮設薬注 据付・撤去 一式]
N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
R 936	仮設次亜注入 設備制御盤	KLF-3  仮設次亜貯蔵 槽電極（4P）	CEE/F 1.25 sq - 4 c	P&D	1.5	(1.5)
				RACK		
				CP	9.9	0.6 + 3.4 + 0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.3 + (3.0)+ 0.6
				FEP		
			PF 22 mm	CP		
				露出	5.9	0.7 + 0.7 + 0.6 + 0.3 + (3.0)+ 0.6
				埋込		
R 938	仮設次亜注入 設備制御盤	PB  PB		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
			PF 54 mm	CP		
				露出	4.0	0.6 + 3.4
				埋込		
R 939	仮設次亜注入 設備制御盤	PB  PB		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
			PF 42 mm x 2	CP		
				露出	4.0	0.6 + 3.4
				埋込		
R 940	分電盤	仮設次亜ハウ ス（電灯盤）	600V CE/F 3.5 sq - 2 c	P&D	3.0	(1.5)+ (1.5)
				RACK		
				CP	11.4	5.9 + 1.4 + 3.5 + 0.6
				FEP		
			1E/F 2 sq	CP	14.4	3.0 + 11.4
			PF 22 mm	露出	11.4	5.9 + 1.4 + 3.5 + 0.6
				埋込		
				P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
				CP		
				露出		
				埋込		

[仮設薬注 据付・撤去 一式]

[illegible]

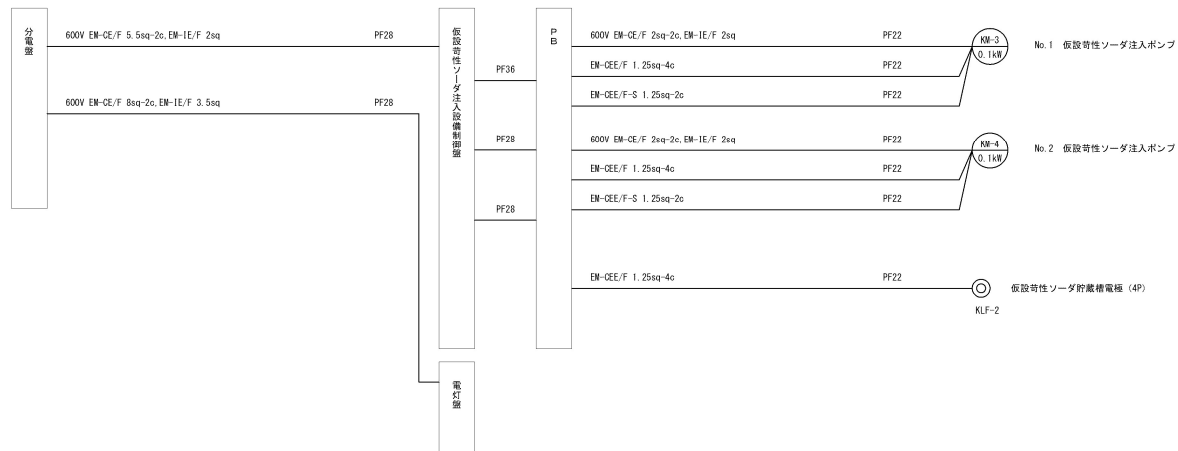
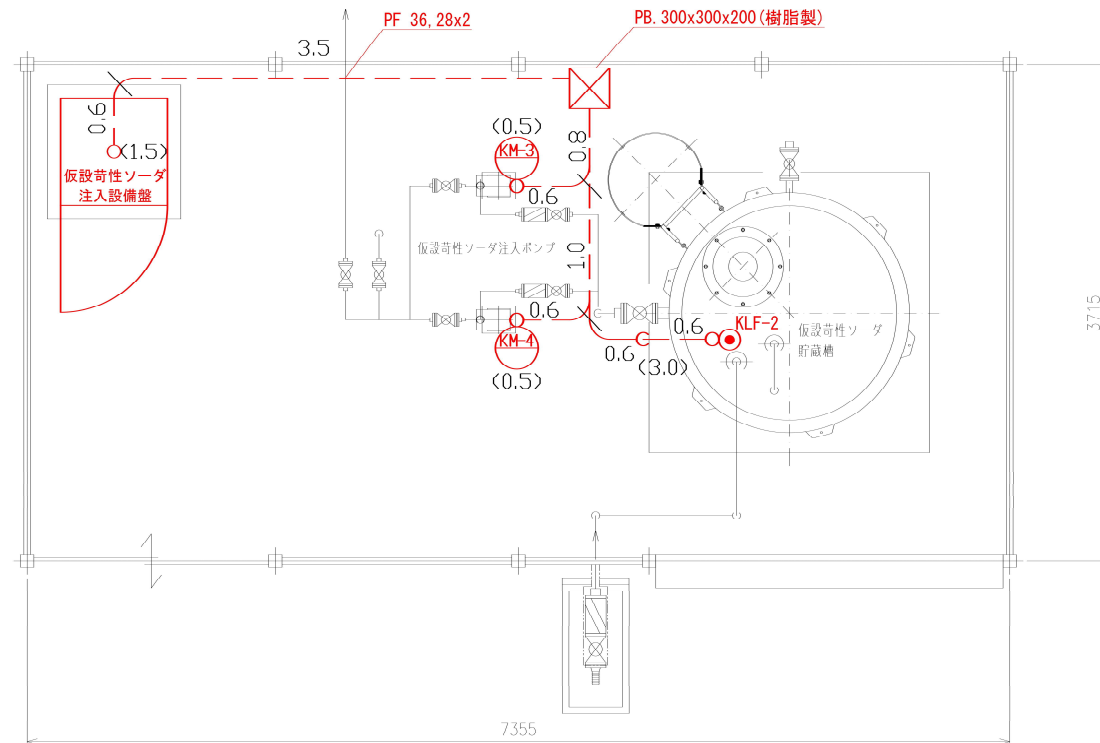


薬品注入設備  
場内配線図(仮設)  
尺度: 1/50



薬品注入設備更新工事  
PAC注入設備 配線図(仮設)  
尺度：1/20





薬品注入設備更新工事  
苛性ソーダ注入設備 配線図(仮設)  
尺度：1/20

